

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成27年11月5日(2015.11.5)

【公表番号】特表2014-525341(P2014-525341A)

【公表日】平成26年9月29日(2014.9.29)

【年通号数】公開・登録公報2014-053

【出願番号】特願2014-529915(P2014-529915)

【国際特許分類】

A 6 1 M 16/06 (2006.01)

【F I】

A 6 1 M 16/06 A

【手続補正書】

【提出日】平成27年9月7日(2015.9.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ユーザーの鼻を覆うとともにユーザーの口を少なくとも部分的に覆い、酸素をユーザーに送るよう構成されたフェイスマスクであって、

ガスのポケットを収容するようになされたリザーバーと、

ガスを該リザーバーへ送達するよう構成された入口ポートと、

該フェイスマスクの正中線の両側に位置し、該リザーバーからのガスを該フェイスマスクから排出するよう構成され、それぞれが中心を有する第1及び第2の通気口と、

該第1の通気口の該中心に位置する第1の側方サンプリングポートと該第2の通気口の該中心に位置する第2の側方サンプリングポートであって、各該第1及び第2の側方サンプリングポートは、該フェイスマスク内に延びて該リザーバーと流体連通しており、該リザーバー内の該ガスのポケットをサンプリングするよう構成された第1及び第2の側方サンプリングポートと、

該第1及び第2の側方サンプリングポートのうちの少なくとも1つの上に位置し、導管に接続するよう構成されたコネクターと、

を含むフェイスマスク。

【請求項2】

各前記第1及び第2の通気口は、それぞれの前記第1及び第2の側方サンプリングポートの周りを囲む複数の通気口孔を含むことを特徴とする、請求項1に記載のフェイスマスク。

【請求項3】

ユーザーの顔に取り外し可能に接続されて、前記フェイスマスク内にガスを保持するよう構成されているマスク封止部分を形成するよう構成された部分を更に含む、請求項1に記載のフェイスマスク。

【請求項4】

ユーザーの鼻を覆うとともにユーザーの口を少なくとも部分的に覆うように構成されたフェイスマスクを含む呼吸マスクシステムであって、

前記フェイスマスクは、

ガスのポケットを収容するようになされたリザーバーと、

ガスを該リザーバーへ送達するよう構成された入口ポートと、

該フェイスマスクの正中線の両側に位置する第1及び第2の側方サンプリングポートと

該フェイスマスク内のガスの流れを提供し、該リザーバーからのガスを放出するように構成された第1及び第2の通気口と、

該第1の側方サンプリングポートに連結され、呼吸ガスを検出するように構成されるセンサーと、を含み、

該第1の側方サンプリングポートが該第1の通気口の中心に位置し、該第2の側方サンプリングポートが該第2の通気口の中心に位置し、該第1及び第2の側方サンプリングポートが該リザーバーからの該呼吸ガスを検出するように構成される、

呼吸マスクシステム。

【請求項5】

前記センサーが検出した呼吸ガスのレベルが閾値量と異なる場合に信号を提供するように構成されているアラームを更に含む、請求項4に記載のシステム。

【請求項6】

前記センサーは、二酸化炭素圧力を検出するように構成されていることを特徴とする、請求項4に記載のシステム。

【請求項7】

前記フェイスマスクは、酸素入口ポートを更に含む、請求項4に記載のシステム。